2025年11月現在

『3D半導体実装技術』正誤表

このたびは、『3D半導体実装技術』をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本書の内容に以下の訂正箇所がございましたので、訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

箇 所		誤	正
目-1	最終行	４．シリコン深掘りプロセス	４．シリコン深掘りプロセスの実際
本文44頁	上から4行目	４．シリコン深掘りプロセス	４．シリコン深掘りプロセスの実際